

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

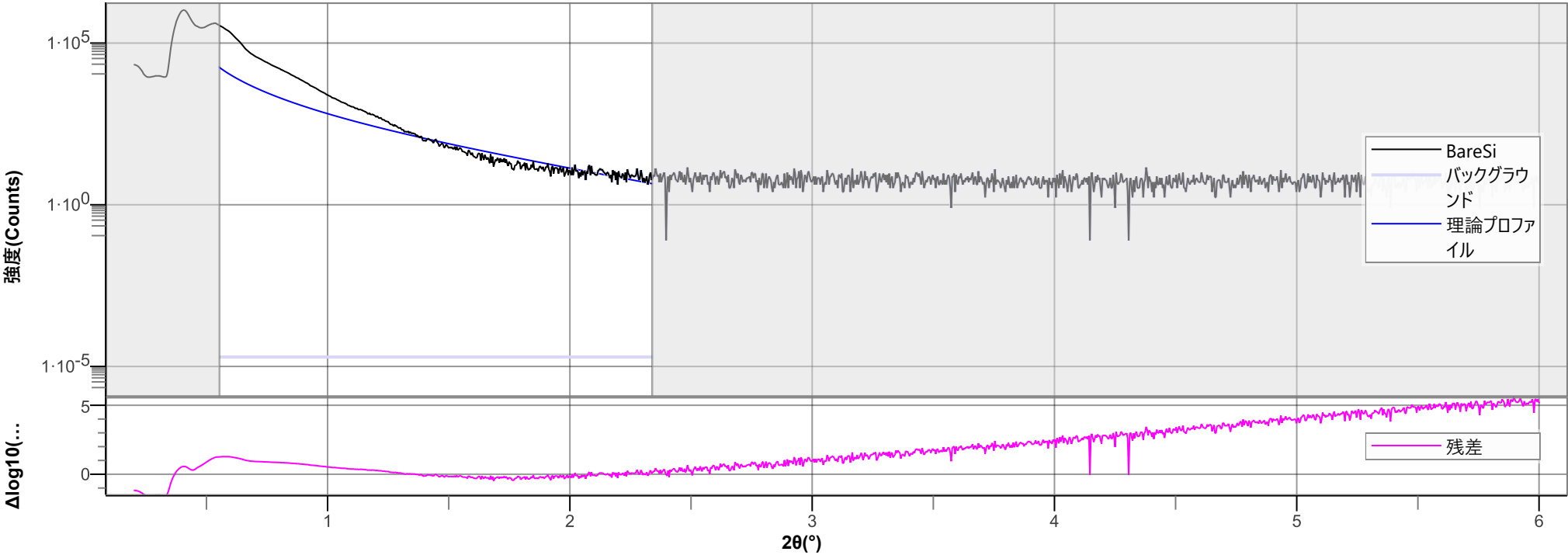
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm ³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.787 ±0.03	Con... 精密化